

装置・技術担当者一覧

総責任者： 入船 徹男

A. センター設置装置・技術

I. 超高压装置群 (超高压実験装置と関連装置)			
	[通称]	[装置型番]	[管理・実施責任者]
(1)	マルチアンビル超高压発生装置	Orange-1000	西原遊, 新名亨
(2)	マルチアンビル超高压発生装置	Orange-3000	大内智博, Steeve Gréaux, 新名亨
(3)	D-DIA型超高压変形装置	Madonna I	大内智博, 西原遊, 新名亨
(4)	DIA型焼結ダイヤモンドアンビル超高压装置	Madonna II	西真之, 新名亨
(5)	ダイヤモンドアンビルセル	DAC	境毅, 大藤弘明
(6)	DAC用ファイバーレーザー加熱システム	Fiber laser	境毅, 大藤弘明
(7)	DAC用CO ₂ レーザー加熱システム	CO ₂ laser	境毅, 大藤弘明
(8)	マルチアンビル装置用高圧下弾性波速度測定装置	Ultrasonic	TDS5104 河野義生, Steeve Gréaux
II. 微小試料分析装置 (電子顕微鏡および関連装置とX線回折・分光装置等)			
(9)	電界放出型走査電子顕微鏡 (EDS付き) ①	FE-SEM-EDS	JSM-7000F 大内智博, 西, 大藤弘明
(10)	電界放出型走査電子顕微鏡 (EBSD付き)	FE-SEM-EBSD	JSM-7000F 大内智博, 西, 大藤弘明
	電界放出型走査電子顕微鏡 (EDS付き) ②		JSM-IT500HR 大内智博, 西
(11)	走査型電子顕微鏡 (EDS付き)	SEM-EDS	JSM-6510LV 大内智博, 西, 大藤弘明
(12)	分析透過型電子顕微鏡 (電界放出型)	FE-TEM	JEM-2100F 大内智博, 西, 大藤弘明
(13)	透過型電子顕微鏡 (熱電子銃型)	TEM	JEM-2010 大内智博, 大藤弘明
(14)	集束イオンビーム (デュアルビーム) 加工装置	Dual Beam FIB	Scios 境毅, 大藤弘明
(15)	集束イオンビーム加工装置	FIB	JEM-9310FIB 境毅, 大藤弘明
(16)	微小領域X線回折装置	Micro-focus XRD	RAPIDII-V/DW 境毅, 新名亨, 大藤弘明
(17)	粉末X線回折装置	Powder XRD	UltimaIV/DD 新名亨, 西, 境毅, 大藤弘明
(18)	顕微ラマン分光装置 (日本分光)	Micro-Raman Spectroscopy	NRS-5100gr 境毅, 新名亨, 大藤弘明
(19)	顕微ラマン分光装置 (Photon Design)	Micro-Raman Spectroscopy	RSM 800 境毅, 新名亨, 大藤弘明
(20)	顕微赤外レーザーラマン分光装置	Micro-Raman (NIR) Spectroscopy	NRS-4500 境毅, 新名亨, 大藤弘明
(21)	顕微赤外分光装置	FT-IR	Spectrum One 西原遊, 新名亨
(22)	紫外可視赤外分光システム	UV-Vis-NIR	V-670 新名亨, 大藤弘明
(23)	レーザー顕微鏡	Laser microscope	OPTELCIS HYBRID L3 新名亨, 大藤弘明
(24)	イオン研磨加工装置 (イオンスライサ)	Ion Slicer	EM-09100 IS 大内智博, 大藤弘明
(25)	イオン研磨加工装置 (クロスセクションポリッシャ)	Cross Section Polisher	IB-19510CP 大内智博, 大藤弘明
(26)	イオン研磨加工装置 (アルゴンイオンミリング)	PIPS	Model 691 大内智博, 大藤弘明
	オスミウム・白金・金・カーボン蒸着装置	Coater	Neoc-STB/JFC-1600/JEC-560 大内智博, 大藤弘明
III. 加工装置・その他の特徴ある装置			
(27)	超音波加工機		UM-150CS 西原遊, 大内智博
(28)	自動バーツ加工機①		MDX-540 西真之, 新名亨, Steeve Gréaux
	自動バーツ加工機②		MDX-40a 西原遊, 新名亨, 西真之, Steeve Gréaux
(29)	高温雰囲気炉①	大型炉	ATCM50-100/1700 大内智博, 新名亨
(29)	高温雰囲気炉②	小型炉	TS-4B06 西原遊, 新名亨
(30)	マイクロピッカース硬度計		HMV-G21DT 新名亨, 大藤弘明
	大型平面研磨盤		GS-BMHF 新名亨
	精密ボール盤		JIG-3M-1 西原遊, 新名亨, 大内智博
	コンターマシン		V-33 西原遊, 新名亨
	自動研磨機		EcoMet3000 西原遊, 新名亨, 大藤弘明
	ファイバーレーザー加工装置①	DAC用	FL-LM 01 境毅, 新名亨
	ファイバーレーザー加工装置②	MA用	ML-7111A 西原遊, 新名亨
	ダイヤモンド研磨機		MCBS-320 入船徹男, 新名亨
	大型NCタッピング装置		MTV-T310; KIRA, PCV-30 新名亨
	CCD形状観察装置 (キーエンス)		VHX-2000 新名亨, 大藤弘明
	デジタルマイクロスコープ (ライカ)		DVM6 新名亨, 大藤弘明
	炉床昇降式高温電気炉		SPM65-17 河野義生
IV. 数値計算用コード			
(31)	鉱物物性シミュレーションコード		
(32)	数値流体シミュレーションコード		
			土屋卓久, 出倉春彦
			亀山真典
V. センター外設置装置・技術			
(33)	変形機構付きガイドブロック (SPring-8 BL04B1 ビームライン)		
(34)	X線その場観察弾性波速度測定装置 (SPring-8 BL04B1 ビームライン)		
	高速度カメラ (SPring-8 BL04B2 ビームライン)		
		FASTCAM Mini AX100	河野義生
VI. センター合成のナノ多結晶ダイヤモンド (ヒメダイヤ)			
	各種の応用研究用としてヒメダイヤの合成ならびに最適加工	NPD	入船徹男, 新名亨

[製造元]

住友重機工業 (株)
住友重機工業 (株)
住友重機工業 (株)
住友重機工業 (株)
シンテック, その他
-
Tektronix
JEOL
JEOL
JEOL
JEOL
JEOL
FEI
JEOL
Rigaku
Rigaku
JASCO
PHOTON Design
JASCO
PerkinElmer
JASCO
レーザーテック
JEOL
JEOL
Gatan
メイワフォーシス/JEOL
日本電子工業
Roland
中外ブロックス
ニッカトー
島津製作所
黒田精工
土佐テック
Luxo
Buehler
日本オプテル
MIYACHI
シンテック
Mectron
キーエンス